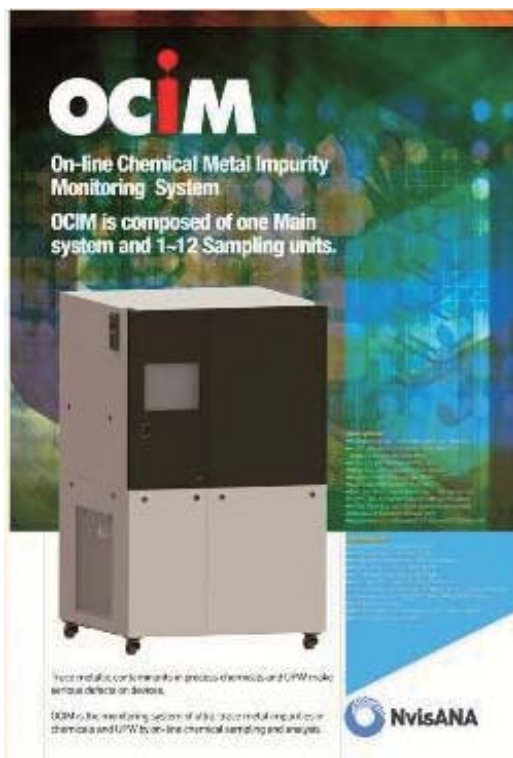


OCIM : Online ケミカル汚染監視システム

●OCIM : Online ケミカル汚染監視システム

- Sampling/ 前処理 / 測定 / 後洗浄まで全自動で行う
オンライン監視システム
- 測定に人を介さない安全設計
- メインユニットとサンプリングユニットで構成。
最大 60ch を 1 つのメインユニットで測定可能
- バルクケミカル、プロセスケミカル、UPW、
プロセスガスの測定が可能
- インターロックシステムと連動したリークセンサーと
ガス検知器を装備

製品イメージ



- OCIM : ケミカル、UPW、ガス中の金属不純物を sub-ppt レベルで On-Line/Real-Time 分析。安全かつサンプルの汚染を防止した全自動サンプリング / 分析システム。

WCS-300M : 全自動 / 一体型 VPD-ICP-MS システム

- WCS-300M : 全自動 / 一体型 VPD-ICP-MS システム
 - Sampling/VPD/ICP-MS を省スペースの筐体に収めた一体型システム。
 - ICP-MS システム校正、サンプルチューブの自動洗浄、清浄度の自己診断、スキャン溶液、クリーニング溶液の自動調製により前処理、後処理まで自動化。
 - 親水面、疎水面のどちらでも測定可能。
 - Full, Radial, Point, Edge, Bevel など、測定箇所をカスタマイズできます。
 - インターロックシステムと連動したリークセンサーとガス検知器を装備。
 - 駆動部、試薬吐出部を筐体に収め、作業者への衝突、被液を防止。

製品イメージ



- WCS-300M :WCS-300M ウエハー上の金属汚染を sub-ppt レベルで高感度分析が可能。高い安全性を持ち、前処理から後洗浄まで自動化した全自動 VPD-ICP-MS システム。